Магнитное управление кинетической индуктивностью в элементах сверхпроводниковой электроники

А. А. Неило⁺, С. В. Бакурский^{*1)}, Н. В. Кленов⁺, И. И. Соловьев^{+×}, М. Ю. Куприянов^{*}

+ Физический факультет, МГУ имени М.В.Ломоносова, 119991 Москва, Россия

*Научно-исследовательский институт ядерной физики им. Д.В.Скобельцына МГУ, 119991 Москва, Россия

[×] Московский физико-технический институт, 141700 Долгопрудный, Россия

Поступила в редакцию 2 ноября 2024 г. После переработки 12 ноября 2024 г. Принята к публикации 18 ноября 2024 г.

Теоретически исследован продольный электронный транспорт в многослойной сверхпроводниковой (S) структуре SF₁S₁F₂sN с двумя ферромагнитными (F) слоями и слоем нормального металла (N). Расчеты показали, что поворот намагниченности ферромагнитных слоев друг относительно друга позволяет плавно изменять величину кинетической индуктивности структуры в несколько раз. Мы обнаружили особенность электронного состояния структуры в области параметров системы, соответствующей ее переходу от состояния с устойчивой джозефсоновской фазой 0 к состоянию с устойчивой фазой π (0– π переход). Эта особенность приводит к подавлению синглетной компоненты амплитуды спаривания и росту кинетической индуктивности всей структуры. Исследование влияния конечного продольного тока на транспорт заряда показало, что разрушение сверхпроводимости в разных слоях происходит по очереди, и на зависимости $L_K(J)$ есть несколько плато с почти постоянной величиной индуктивности.

DOI: 10.31857/S0370274X25010101, EDN: MCMJJU

Введение. Сверхпроводниковая электроника позволяет создавать ряд новых типов энергоэффективных и быстродействующих элементов для информационных и телекоммуникационных систем, включая нейроморфные вычислители [1–3], квантовые [4–6] и классические супер-компьютеры [7, 8], а также совместимые с ними высокочувствительные детекторы [9]. При этом элементная база для создания таких устройств не стоит на месте: постоянно появляются концепции новых элементов, основанных на новых физических принципах. Одним из таких элементов стали устройства с большой кинетической индуктивностью [10–13].

Индуктивность отвечает за реактивную компоненту импеданса при переносе заряда, определяя коэффициент пропорциональности между энергией протекающего тока и квадратом его амплитуды. При этом энергия запасается как в сопутствующем магнитном поле (геометрическая компонента индуктивности), так и в кинетической энергии носителей заряда (кинетическая компонента индуктивности). В ряде сверхпроводников с высоким удельным сопротивлением, таких как NbN и гранулированнный алюминий GrAl [14–17], эта кинетическая компонента может на порядки превышать геометрическую индуктивность, что позволяет получать компактные элементы на чипе с индуктивностями порядка нано- и микрогенри. Использование таких элементов может обеспечить прогресс в борьбе за масштабируемость цифровых и аналоговых сверхпроводниковых схем, поскольку позволит уменьшить размеры квантующих контуров быстрой одноквантовой (SFQ – Single Flux Quantum) логики. Кроме того, геометрическая компонента индуктивности в таких цепях будет мала, что позволяет значительно уменьшить паразитные наведенные токи, возникающие из-за взаимной индукции.

В то же время в ряде случаев подобные элементы кинетической индуктивности проявляют нелинейные свойства, что позволяет управлять характерными частотами сверхпроводниковых цепей с помощью задания тока смещения, нагрева или приложения электрического поля [18, 19]. На основе данных эффектов возможно реализовать смещение резонансной частоты составных элементов слаботочных сверхпроводниковых устройств, создавать параметрические усилители [20–24] и детекторы [25–27]. Также сейчас существует интерес к конструированию элементов с возможностью энергонезависимой подстройки индуктивности в широком диапазоне ее зна-

¹⁾e-mail: r4zz@mail.ru

чений в составе сверхпроводниковых синапсов, нейронов и роутеров [28]. В данной работе мы предлагаем концепцию экспериментальной реализации такого элемента – энергонезависимого переключателя на основе ферромагнитного спинового вентиля [29–36].

Работа устройства основана на использовании спин-триггерного эффекта [37, 38], суть которого заключается в переводе тонкого сверхпроводникового *s*-слоя, подавленного обратным эффектом близости со стороны ферромагнетика и нормального металла, в собственное сверхпроводящее состояние за счет проникновения парных корреляций со стороны объемного сверхпроводника S – источника куперовских пар (см. рис. 1). В зависимости от угла разо-



Рис. 1. (Цветной онлайн) (a) – Эскиз SF₁S₁F₂sN структуры с управляемой кинетической индуктивностью. (b) – Схематическое изображение расположения элемента с управляемой кинетической индуктивностью на чипе между двумя широкими сверхпроводниковыми линиями

риентации векторов намагниченности ферромагнитных слоев спинового вентиля $F_1s_1F_2$, расположенного между источником S и слоем-триггером s, вентиль либо пропускает, либо разрушает парные корреляции, что позволяет управлять состоянием s-слоя. При этом открытие вентиля приводит к переходу слоя-триггера s в сверхпроводящее состояние, что, в свою очередь, порождает резкий рост количества сверхпроводящих носителей внутри низкоомного металлического слоя N за счет эффекта близости. В том случае, когда такой N-материал обладает малым удельным сопротивлением и большой длиной когерентности, его кинетическая индуктивность в проксимизированном состоянии оказывается существенно меньше кинетической индуктивности остальных слоев многослойной структуры. В силу этого проксимизация N-пленки должна сопровождаться существенным перераспределением транспортного продольного тока в F₁s₁F₂-вентиле и его концентрацией в N-материале.

В данной работе мы теоретически исследуем проблему управления кинетической индуктивностью в подобной структуре за счет плавного изменения угла разориентации векторов намагниченности ферромагнитных слоев; существенно новым в этом рассмотрении также является учет влияния продольного тока конечной величины на свойства такой структуры.

Модель. На рисунке 1 схематически представлена исследуемая $SF_1S_1F_2sN$ -структура. Она состоит из S-электрода, $F_1S_1F_2$ -обменного клапана и сверхпроводящего *s*-слоя, находящегося в контакте с низкоомным нормальным металлом (N). Предполагается, что условие грязного предела выполняется во всех материалах. Тогда $SF_1S_1F_2sN$ -система будет описываться уравнениями Узаделя:

$$D_p \nabla(\hat{g}^R \nabla \hat{g}^R) - [\omega \tau_3, \hat{g}^R] + [i \mathbf{h}_p \boldsymbol{\sigma}, \hat{g}^R] + [\Delta_p \tau_1, \hat{g}^R] = 0,$$
(1)

в которых $D_p = 2\pi T_c \xi_p^2$ – коэффициент диффузии *p*-го слоя, ξ_p , ρ_p – его диффузная длина когерентности и удельное сопротивление соответственно, $\omega = \pi T(2n+1)$ – мацубаровские частоты, T – температура системы, T_c – критическая температура сверхпроводников, образующих многослойную SF₁S₁F₂sN структуру. Запаздывающая функция Грина $\hat{g}^R = \hat{g}\tau_3 + \hat{f}\tau_1$ представима в виде суммы нормальной $\hat{g} = g\sigma_0$ и аномальной $\hat{f} = \sum_{i=0}^3 f_i\sigma_i$ составляющих, τ_i, σ_i – матрицы Паули в квазичастичном (Намбу) и спиновом пространстве соответственно. На границах между слоями использовались граничные условия Куприянова–Лукичева [39]:

$$2\gamma_{Bpq}\hat{g}_p^R\partial_x\hat{g}_p^R = [\hat{g}_p^R, \hat{g}_q^R].$$
(2)

 $\gamma_{Bpq} = R_{Bpq} \mathcal{A}_{Bpq} / \rho_p \xi_p$ – параметр подавления на границе между *p*-м и *q*-м слоями, R_{Bpq} и \mathcal{A}_{Bpq} – сопротивление и площадь соответствующего интерфейса. Условие самосогласования для сверхпроводящего параметра порядка Δ , отличного от нуля только в сверхпроводщих слоях, представимо в виде:

$$\Delta \ln \frac{T}{T_c} = \pi T \sum_{\omega = -\infty}^{+\infty} \left(\frac{\Delta}{|\omega|} - f_0 \right).$$
 (3)

Мы считаем, что ферромагнетики имеют однодоменную структуру с векторами намагниченности $\mathbf{M}_{1,2}$, лежащими в 0zy-плоскости. Следовательно, векто-



Рис. 2. (Цветной онлайн) Пространственные зависимости при разных значениях углов между намагниченностями ферромагнетиков ($\theta = 0, 0.35\pi, \pi$ соответствуют черная сплошная, красная точечная, синяя штрихованная линии) для: (a) – синглетной компоненты амплитуды спаривания f_0 ; (b), (c) – триплетных компонент f_1 , f_2 ; (d) – обратного квадрата лондоновской глубины проникновения λ^{-2} . Голубыми областями обозначены слои $F_{1,2}$ ферромагнетиков, зеленым – N нормального металла, белым – сверхпроводников. Параметры SF₁S₁F₂sN-структуры: $d_S = 5\xi$, $d_{F1} = 0.5\xi$, $d_{S1} = 0.2\xi$, $d_{F2} = 0.6\xi$, $d_s = 4.4\xi$, $d_N = 5\xi$, $\xi_N = 10\xi$, $\rho_N = 0.1\rho$, $h = 10T_C$, $T = 0.5T_C$, $\gamma_B = 0.3$

ра обменного взаимодействия $\mathbf{h}_{1,2}$ отличные от нуля только в F-слоях, определяются следующим образом:

$$\mathbf{h}_1 = h\mathbf{y}\cos\theta + h\mathbf{z}\sin\theta, \quad \mathbf{h}_2 = h\mathbf{z}.$$
 (4)

Предполагается, что материальные параметры у сверхпроводящих и ферромагнитных слоев одинаковы, т.е. $\xi_S = \xi_F = \xi$, $\rho_S = \rho_F = \rho$, а параметры низкоомного металла, ξ_N и ρ_N , могут от них отличаться.

Кинетическая индуктивность $SF_1S_1F_2sN$ структуры определялась выражением:

$$\frac{L_K}{\mathcal{L}_K^0} = \frac{\xi}{\lambda_0^2} \left[\int_0^d \lambda^{-2}(x) dx \right]^{-1}.$$
 (5)

Здесь $\mathcal{L}_{K}^{0} = (\mu_{0}X\lambda_{0}^{2})/(\xi W), \lambda_{0} = 2\pi\mu_{0}T_{c}\rho^{-1}, \mu_{0}$ – проницаемость вакуума, X, W, d – ширина, высота и суммарная толщина SF₁S₁F₂sN-структуры соответственно. Обратный квадрат лондоновской глубины проникновения определялся как:

$$\lambda^{-2}(x) = \lambda_0^{-2} \frac{T\rho}{T_C \rho(x)} \sum_{\omega > 0} \operatorname{Re}(f^2(x)), \qquad (6)$$

Письма в ЖЭТФ том 121 вып. 1-2 2025

где $f^2(x) = f_0^2(x) - f_1^2(x) - f_2^2(x).$

Краевая задача (1)–(4) решалась численно итерационным способом. Найденные в результате расчетов координатные зависимости аномальных функций Грина были использованы для вычисления искомой индуктивности в соответствии с выражениями (5), (6).

Электронная структура. Результаты расчетов электронной структуры в рамках уравнений (1)–(6) приведены на рис. 2 для следующего набора параметров многослойной SF₁S₁F₂sN-структуры: $d_S = 5\xi$, $d_{F1} = 0.5\xi$, $d_{S1} = 0.2\xi$, $d_{F2} = 0.6\xi$, $d_s = 4.4\xi$, $d_N = 5\xi$, $\xi_N = 10\xi$, $\rho_N = 0.1\rho$, $h = 10T_C$, $T = 0.5T_C$, $\gamma_B = 0.3$.

Представленные на рис. 2а–с пространственные зависимости амплитуд спаривания $f_i(x)$ и квадрата обратной глубины проникновения $\lambda^{-2}(x)$ (рис. 2d) для разных направлений векторов намагниченности F-слоев демонстрируют принцип работы исследуемого спинового вентиля. Амплитуды спаривания в области толстого левого сверхпроводника, S, слабо зависят от направлений намагниченности. При этом амплитуды спаривания f_0 и f_1 в тонком *s*-слое увеличиваются в несколько раз при переключении из состояния с параллельными векторами намагниченностей (Р) в "антипараллельное" (АР) состояние за счет более эффективной проксимизации через магнитную многослойку. В свою очередь, появление сверхпроводимости в s-слое приводит к проксимизации нормально металлического N-слоя, в котором появляется заметная амплитуда спаривания f_0 , несмотря на его значительную толщину $d_N = 5\xi$, превосходящую размер находящейся с ним в контакте сверхпроводящей пленки. Более того, расчет пространственного распределения квадрата обратной глубины проникновения $\lambda^{-2}(x)$, по сути эквивалентного пространственному распределению продольного сверхтока по структуре, показывает, что в АР-конфигурации вклад нормального металла в $\lambda^{-2}(x)$ оказывается сопоставимым с вкладом от объемных сверхпроводников. В Р-конфигурации векторов намагниченности эффект близости между S- и sслоями оказывается подавленным. В результате этого амплитуда спаривания f₀ в s- и N-слоях оказывается в разы меньше. Таким образом, изменение взаимной ориентации векторов намагниченности в $SF_1S_1F_2sN$ структуре позволяет изменять пространственное распределение глубины проникновения поля и, соответственно, полную эффективную индуктивность структуры.

Стоит отметить, что возможность формирования π -состояния в джозефсоновской SF₁S₁F₂s структуре не приводит к значительному подавлению сверхпроводимости в s-слое. В P-конфигурации векторов намагниченности F-пленок и при параметрах, представленных на рис. 2, компоненты амплитуды спаривания f_0 в S- и s-слоях имеют разные знаки (так называемое $0-\pi$ состояние). Однако это не мешает проявлению триггерного эффекта и формированию собственной сверхпроводимости в s-слое.

В области параметров, соответствующей $0-\pi$ переходу, может наблюдаться дополнительное подавление сверхпроводимости, типичное для структур с тонкими сверхпроводниковыми слоями. Для рассматриваемой структуры мы можем реализовать $0-\pi$ переход путем поворота одного из векторов намагниченности на конечный угол $\theta = 0.35\pi$. При таком значении угла разориентации намагниченностей θ амплитуда спаривания в *s*-слое подавляется полностью. В этой области параметров спиновый вентиль оказывается топологически закрыт, что приводит к полному подавлению сверхпроводимости в *s*N бислое. Однако данный эффект реализуется лишь в узком диапазоне параметров при малых толщинах *s*-слоя, близких к критической толщине.

Наличие N-слоя и его характеристики также значительно влияют на величину кинетической индуктивности структуры. Чтобы продемонстрировать данный эффект, мы провели расчеты электронной структуры рассматриваемой многослойки для разных параметров нормального слоя и провели сравнение кинетической индуктивности в параллельной и антипараллельной конфигурациях вентиля. На рисунке 3 представлена разность кинетической индуктивности в Р- и АР-конфигурациях намагниченности $\delta L_K = L_K^P - L_K^{AP}$ для ${\rm SF_1S_1F_2}s({\rm N})$ -структуры как функция толщины слоя триггера, s, для разных типов нормально-металлического покрытия. Данная величина удобна для оценки величины спинвентильного эффекта в многослойной структуре с учетом влияния используемых материалов на критическую толщину *s*-слоя.



Рис. 3. (Цветной онлайн) Зависимость разности кинетических индуктивностей в Р- и АР-ориентациях δL_K от толщины s-слоя d_s для разных толщин и удельных сопротивлений нормального металла. Черная сплошная линия соответствует базовой SF₁S₁F₂s структуре без покрытия нормальным слоем; красная штрихованная линия – случаю тонкого низкоомного N-слоя; синяя пунктирная линия – случаю толстого низкоомного N-слоя; зеленая точечная линия – случаю толстого N-слоя с сопротивлением, как у всех материалов в системе. Параметры SF₁S₁F₂sN структуры: $d_S = 5\xi$, $d_{F1} = 0.5\xi$, $d_{S1} = 0.2\xi$, $d_{F2} = 0.6\xi$, $\xi_N = 10\xi$, $h = 10T_C$, $T = 0.5T_C$, $\gamma_B = 0.3$

Черная сплошная линия на рис. 3 показывает изменение кинетической индуктивности для базовой структуры без покрытия нормальным слоем. При малых толщинах сверхпроводящего *s*-слоя d_s его собственная сверхпроводимость оказывается подавленной во всем диапазоне углов разориентации векторов намагниченности θ . В результате изменение θ слабо влияет на величину общей кинетической индуктивности.

В обратном пределе очень больших d_s *s*-слой наоборот достаточно толст, чтобы переходить в собственное сверхпроводниковое состояние вне зависимости от того, есть ли подпитка парными корреляциями со стороны сверхпроводника источника S.

Наиболее эффективно спин-вентильный эффект проявляется в промежуточном интервале толщин $2\xi < d_s < 4\xi$. В этом случае в системе реализуется спин-триггерный эффект, заключающийся в переходе *s*-слоя в собственное сверхпроводящее состояние только при наличии подпитки со стороны сверхпроводника источника S при открытом спиновом вентиле. В этом случае изменение полной кинетической индуктивности структуры δL_K при перемагничивании вырастает в 3–4 раза относительно предельных случаев больших и маленьких толщин d_s .

В свою очередь добавление нормальнометаллического слоя N поверх сверхпроводника s может в несколько раз усилить спин-вентильный эффект в окрестности максимума зависимости $\delta L_K(d_s)$. На рисунке 3 показана завимость $\delta L_K(d_s)$ для случая использования материала с высокой длиной когерентности $\xi_N = 10\xi$ и удельным сопротивлением, как у сверхпроводника $\rho_N = \rho$ (зеленая точечная линия). Использование такого материала слабо влияет на критическую толщину сверхпроводникового слоя триггера d_s , при которой достигается максимум зависимости, зато увеличивает амплитуду максимума δL_K больше, чем в полтора раза.

Использование низкоомного нормального металла с $\rho_N = 0.1\rho$ позволяет увеличить спинвентильный эффект еще сильнее. Синей пунктирной линией показана зависимость $\delta L_K(d_s)$ для $\rho_N = 0.1\rho$ и толстого нормального слоя $d_N = 5\xi$. При этом эффективное подавление сверхпроводника *s* за счет обратного эффекта близости со стороны N слоя тоже увеличивается, что приводит к смещению максимума зависимости $\delta L_K(d_s)$ к новой критической толщине *s*-слоя большей чем 4 ξ .

Уменьшение толщины нормального слоя до $d_N = \xi$ (красная пунктирная линия) позволяет ослабить данный эффект, но одновременно ведет и к ослаблению спин-вентильного эффекта.

Зависимость кинетической индуктивности L_K от угла разориентации векторов намагниченности ферромагнитных слоев θ продемонстрирована на рис. 4 для структуры с параметрами нормального слоя $d_N = 5\xi$, $\rho_N = 0.1\rho$ и разными толщинами *s*-слоя. Фактически, данный рисунок является детализацией синей пунктирной кривой на рис. 3.



Рис. 4. (Цветной онлайн) Зависимость кинетической индуктивности L_K от угла разориентации намагниченностей θ для разных толщин *s*-слоя. Параметры SF₁S₁F₂*s*N-структуры: $d_S = 5\xi$, $d_{F1} = 0.5\xi$, $d_{S1} = 0.2\xi$, $d_{F2} = 0.6\xi$, $d_N = 5\xi$, $\xi_N = 10\xi$, $\rho_N = 0.1\rho$, $h = 10T_C$, $T = 0.5T_C$, $\gamma_B = 0.3$

Видно, что при маленьких толщинах $d_s = 3\xi$ зависимость L_K от угла θ практически отсутствует (черная линия на рис. 4). Здесь, как в Р, так и в АР ориентациях собственная сверхпроводимость в *s*слое мала, а величина общей нормированной индуктивности близка к единице, что соответствует кинетической индуктивности слоя источника S.

Увеличиние толщины *s*-слоя в диапазоне $d_s = 4-4.6\xi$ (красная, синяя, зеленая и оранжевые линии) приводит к формированию в нем собственной сверхпроводимости и падению общей индуктивности, что происходит раньше в AP конфигурации и позже в P-направлении намагниченности.

При этом зависимость $L_K(\theta)$ оказывается нелинейной: ее максимум в широком диапазоне толщин наблюдается при $\theta \approx 0.35\pi$, что соответсвует точке $0-\pi$ перехода между *s* и S-слоями. В этом случае, сверхпроводимость *s*-слоя оказывается дополнительно подавлена фактом $0-\pi$ перехода, что приводит к дополнительному усилению спин-вентильного эффекта. Тем не менее данный эффект ослабевает по мере увеличения толщины сверхпроводникового *s*-слоя до значений, значительно превышающих критическую. При толщинах $d_s > 5\xi$ индуктивность слабо зависит от угла θ), а $0-\pi$ переход происходит резким скачком, слабо влияя на измеряемые параметры структуры.

Протекание продольного тока. Задание конечного продольного сверхтока вдоль многослойной структуры (вдоль оси 0z) может значительно повлиять на величину индуктивности и распределение токов между слоями из-за эффекта подавления сверхпроводимости протекающим по структуре током.

Для оценки этих эффектов, мы модифицировали уравнения (1)–(5) по аналогии с работами [19, 40– 43], представив потенциал спаривания и компоненты ампулитуды спаривания в виде $\Delta(x,z) = \Delta(x)e^{izq}$ и $f_i(x,z) = f_i(x)e^{izq}$ соответственно, где q – не зависящий от координаты x градиент фазы параметра порядка вдоль оси 0z.

В этом случае уравнение (1) сохраняет свой вид с точностью до замены в нем мацубаровской частоты ω на $\omega + D_p q^2 g/2$. При таком подходе распределение плотности тока j(x) по толщине структуры определяется выражением

$$j(x) = \frac{2\pi T}{e\rho(x)} q \sum_{\omega > 0} \operatorname{Re}(f^2(x)) = \frac{2\pi T_C \lambda_0^2}{e\rho \lambda^2(x,q)} q, \qquad (7)$$

а суммарный транспортный ток J находится посредством интегрирования выражения (7) по суммарной толщине структуры d:

$$J = W \int_0^d j(x) dx. \tag{8}$$

При выводе выражений (7), (8) мы преполагали, что суммарная толщина всех слоев структуры $d = \sum_p d_p$ значительно меньше лондоновской глубины проникновения λ_0 , а ширина полоски значительно меньше величины λ_0^2/d . Помимо этого, мы пренебрегали влиянием магнитных полей рассеяния ферромагнетиков, т.е. считали, что q есть константа, независящая от пространственных координат. Таким образом, после интегрирования в (8) и подстановки выражения для кинетической индуктивности (5) получается выражение, фактически являющееся альтернативным определением кинетической индуктивности L_K :

$$q\xi = \frac{L_K(q)}{\mathcal{L}_K^0} \frac{J}{J_0},\tag{9}$$

где $J_0 = 2\pi T_C W/e\rho$ – нормировка тока.

Для решения задачи об определении зависимости кинетической индуктивности от фазы необходимо получить соотношение между градиентом фазы и током q(J). Данная проблема решалась итерационным способом.

Сначала по формулам (6), (5) рассчитывались зависимость $\lambda^{-2}(x)$ и величина L_K при нулевом транспортном токе. На их основе из соотношения (9) для заданного тока J определялось значение градиента фазы параметра порядка q в первом приближении.

После подстановки получившегося на предыдущем шаге значения q в уравнение Узаделя определялось распределение $\lambda^{-2}(x,q)$ и величина $L_K(q)$ в

следующей итерации и по формуле (9) уточнялось значение q. Итерационный процесс по q заканчивался при достижении относительной точности 10^{-4} . Полученное в итоге значение q(J) использовалось для расчета зависимости $L_K(J)$ в рамках модицифированного уравнения Узаделя.



Рис. 5. (Цветной онлайн) (а) – Зависимость кинетической индуктивности L_K от тока смещения J для Р- и AP-конфигураций намагниченности структуры (красная штриховая и черная сплошная кривые соответственно). На вставке показана эквивалентная зависимость дифференциальной индуктивности $L_K^{\text{dif}}(J)$. (b) – Пространственное распределение обратного квадрата лондоновской глубины проникновения λ^{-2} для AP-конфигурации намагниченностей структуры при разных величинах тока смещения, отмеченных звездочками на панели (а). Параметры SF₁S₁F₂sN-структуры: $d_S = 5\xi$, $d_{F1} = 0.5\xi$, $d_{S1} = 0.2\xi$, $d_{F2} = 0.6\xi$, $d_s = 4.4\xi$, $d_N = 5\xi$, $\xi_N = 10\xi$, $\rho_N = 0.1\rho$, $h = 10T_C$, $T = 0.5T_C$, $\gamma_B = 0.3$

На рисунке 5а показана зависимость кинетической индуктивности $SF_1S_1F_2sN$ структуры от величины тока J для P- и AP-взаимной ориентаций век-

торов намагниченности F-пленок (красная штриховая и черная сплошная кривые соответственно). Видно, что зависимости имеют два плато со слабым изменением $L_K(J)$ и переходную область между ними с более быстрым подъемом. При больших токах $J \approx 0.13 - 0.14 J_0$ начинается процесс разрушения куперовских пар в основном электроде S, что приводит к исчезновению парных корреляций в структуре в целом и появлению расходимости на рассчитываемой зависимости для индуктивности структуры, переходящей в резистивный режим. При этом в АРконфигурации критическое значение тока распаривания оказывается больше, что связано с более слабым подавлением сверхпроводимости в S-электроде за счет обратного эффекта близости по сравнению со случаем Р-конфигурации намагниченности.

Эффективная ступенька на зависимости $L_K(J)$ связана с разрушением сверхпроводимости в бислое sN по мере увеличения тока. При этом ступенька ярче проявлена в случае AP-намагниченности из-за того, что в параллельном случае сверхпроводимость в sN бислоя сильно подавлена даже в отсутствии тока. Стоит отметить, что такое свойство обусловлено подбором параметров структуры для эффективного управления полной индуктивностью изменением намагниченности в отсутствии тока.

На нижнем плато зависимости $L_K(J)$ для АРконфигурации ток распределен между S и sN слоями. По мере увеличения тока до 0.07 J_0 происходит подавление сверхпроводимости в sN бислое, что приводит к значительному изменению распределения тока в структуре. Для демонстрации этого эффекта на рис. 5b показано пространственное распределение обратного квадрата глубины проникновения $\lambda^{-2}(x)$, которое в соответствии с формулой (7) эквивалентно пространственному распределению тока j(x) по структуре.

На черной сплошной кривой на рис. 5b видно, что при нулевом токе суммарное соотношение $\lambda^{-2}(x)$ между S-электродом и sN-частью примерно одинаковое. Однако, сверхпроводимость в s-слое является более слабой, чем в S-электроде, вследствие чего увеличивающийся ток будет сильнее разрушать сверхпроводящие корреляции в sN-части. В результате, в диапазоне токов от 0 до $\sim 0.05J_0$ величина $\lambda^{-2}(x)$ заметно уменьшается в области sN бислоя, а ее величина в S-электроде, напротив, остается практически неизменной. Далее, в переходной области ($0.05-0.07J_0$) происходит окончательное разрушение сверхпроводимости в sN-части, и кинетическая индуктивность структуры полностью определяется состоянием толстого S-слоя. Дальнейший рост L_K связан с разрушением сверхпроводимости непосредственно S-электрода, где в диапазоне $0.07 - 0.14 J_0$ наблюдается постепенное уменьшение амплитуды спаривания и, соответственно, величины $\lambda^{-2}(x)$.

Вышеописанное поведение находится в соответствии с результатами работ [19, 43-45], где распаривание токового канала в слое низкоомного металла происходит при меньших токах, чем в слое объемного сверхпроводника. Это означает, что в определенном интервале заданных в структуру токов возможно разрушение транспорта только в *s*N бислое и сохранение транспортных свойств источника куперовских пар S. При этом в данной работе мы не рассматриваем случай критических параметров, разобранный в [19, 43-45], что не позволяет выделить эффект "распаривания" в N-слое. Вместо этого sN бислой фактически выступает единым элементом структуры с меньшей критической температурой и критическим током, чем у толстого S-электрода, однако обладающим низкой удельной индуктивностью за счет малого удельного сопротивления металла.

Необходимо отметить, что кроме определения индуктивности в виде коэффициента пропорциональности между градиентом фазы и полным током часто [19, 41] используется дифференциальная кинетическая индуктивность

$$L_K^{\text{dif}} = J_0 \mathcal{L}_K^0 \frac{dq}{dJ} = L_K + \frac{dL_K}{dJ} J.$$
(10)

Для сравнения эта величина показана на вставке к рис. 5а для тех же параметров, что и для основного графика. Она характеризуется тем, что в области быстрого роста $L_K(J)$, связанного с разрушением сверхпроводимости в одном из слоев, на зависимости $L_K^{\text{dif}}(J)$ может сформироваться дополнительный максимум.

При этом в зависимости от конкретного эксперимента при измерении кинетической индуктивности может быть получена как ее полная величина, так и дифференциальная. Например, в эксперименте [46] на образец подается постоянный ток смещения и исследуется влияние слабого переменного сигнала, что соответствует величине L_K^{dif} . С другой стороны, в экспериментах по исследованию пространственного распределения тока в интерферометрах с мостиками Дайема [47, 48] определяется полная индуктивность L_K , поскольку в этом случае играет роль полная энергия системы. В более сложных процессах с большим переменным током необходимо учитывать нелинейность индуктивности в рамках решения зависящей от времени задачи [41], в которой распределение тока по структуре не является равновесным.

Обсуждение. В рамках данной работы мы показали возможность управления кинетической индуктивностью L_k многослойной SF₁S₁F₂sN структуры посредством изменения угла разориентации векторов намагниченности θ двух ферромагнитных слоев, выступающих в роли спинового вентиля. Показано, что при перемагничивании величина L_k может изменяться в несколько раз. При этом плавное изменение угла разориентации намагниченностей в вентиле θ позволяет плавно и в широких пределах изменять кинетическую индуктивность структуры. Данный эффект может быть интересен для устройств, требующих непрерывной подстройки частоты входящих в них сверхпроводниковых контуров.

В том случае, когда изменение угла θ в структуре сопровождается переходом между 0- и π состояниями, зависимость кинетической индуктивности $L_k(\theta)$ становится немонотонной. Она имеет максимум в точке, соответствующей 0- π переходу. Этот эффект можно использовать как для обнаружения 0- π перехода без использования фазовочувствительных схем [49–52], так и для усиления спин-вентильного эффекта.

Возможный способ интеграции подобной структуры в сверхпроводниковые цепи показан на рис. 1b. В этом случае элемент кинетической индуктивности представляет из себя узкую полоску по сравнению с широкими элементами разводки из сверхпроводника, что позволяет обеспечить значительную кинетическую индуктивность управляемого элемента. При этом, конечно, в области затекания тока образуется его концентрация, а распределение тока, показанное на рис. 5b реализуется в центральной части структуры. Однако процессы растекания тока происходят на масштабах порядка толщины структуры, что соответствует десяткам нанометров, а длина такой полоски может составлять от 100 до 1000 нм, что позволяет в первом приближении пренебрегать областями неравномерного растекания тока.

В случае достаточно малых токов $J < 0.02J_0$ структура может быть использована как подстраиваемый линейный реактивный элемент, в котором при перемагничивании изменяется кинетическая индуктивность. В этом диапазоне токов эффекты распаривания пренебрежимо малы.

Возможен и альтернативный способ применения подобной структуры. При задании постоянного тока смещения можно подстраивать разницу электронного транспорта между Р- и АР-конфигурациями. Также можно управлять распределением тока по подобной структуре только током, не изменяя магнитную конфигурацию системы. Финансирование работы. Теоретическое описание и моделирование электронного транспорта многослойной структуры выполнено при финансовой поддержке Российского научного фонда (проект # 22-79-10018, https://rscf.ru/project/22-79-10018/).

Исследование возможных применений и способов интеграции многослойной структуры в схемы выполнено при поддержке Министерства науки и высшего образования Российской Федерации (соглашение 075-15-2024-632). Оптимизация численного алгоритма в окрестности точки распаривания выполнена А. Неило при поддержке Фонда развития теоретической физики и математики "БАЗИС".

Конфликт интересов. Авторы данной работы заявляют, что у них нет конфликта интересов.

- K. Ishida, I. Byun, I. Nagaoka, K. Fukumitsu, M. Tanaka, S. Kawakami, T. Tanimoto, T. Ono, J. Kim, and K. Inoue, IEEE Micro 41, 19 (2021).
- M. Schneider, E. Toomey, G. Rowlands, J. Shainline, P. Tschirhart, and K. Segall, Supercond. Sci. Technol. 35, 053001 (2022).
- M. M. Islam, S. Alam, M.S. Hossain, K. Roy, and A. Aziz, J. Appl. Phys. 133, 070701 (2023).
- 4. I. Siddiqi, Nat. Rev. Mater. 6, 875 (2021).
- V.A. Vozhakov, M.V. Bastrakova, N.V. Klenov, I.I. Soloviev, W.V. Pogosov, D.V. Babukhin, A.A. Zhukov, and A.M. Satanin, Phys.-Uspekhi 65, 457 (2022).
- E. Zikiy, A. Ivanov, N. Smirnov, D. Moskalev, V. Polozov, A. Matanin, E. Malevannaya, V. Echeistov, T. Konstantinova, and I. Rodionov, Sci. Rep. 13, 15536 (2023).
- M. Cuthbert, E. DeBenedictis, R.L. Fagaly et al. (Collaboration), International roadmap for devices and systems. Cryogenic electronics and quantum information processing. 2022 Edition, IEEE (2022).
- C. Pot, W. F. Holmes-Hewett, E.-M. Anton, J. D. Miller, B. J. Ruck, and H. J. Trodahl, Appl. Phys. Lett. 123, 202401 (2023).
- A. V. Semenov, I. A. Devyatov, M. P. Westig, and T. M. Klapwijk, Phys. Rev. Appl. 13, 024079 (2020).
- S. Bakurskiy, M. Kupriyanov, N. V. Klenov, I. Soloviev, A. Schegolev, R. Morari, Y. Khaydukov, and A. S. Sidorenko, Beilstein J. Nanotechnol. **11**, 1336 (2020).
- J. Peltonen, P. Coumou, Z. Peng, T. Klapwijk, J. Tsai, and O. Astafiev, Sci. Rep. 8, 10033 (2018).
- T. Hazard, A. Gyenis, A. Di Paolo, A. Asfaw, S. Lyon, A. Blais, and A. Houck, Phys. Rev. Lett. **122**, 010504 (2019).
- D. Kalacheva, G. Fedorov, J. Zotova, S. Kadyrmetov, A. Kirkovskii, A. Dmitriev, and O. Astafiev, Phys. Rev. Appl. 21, 024058 (2024).

Письма в ЖЭТФ том 121 вып. 1-2 2025

- L. Grünhaupt, N. Maleeva, S.T. Skacel, M. Calvo, F. Levy-Bertrand, A.V. Ustinov, H. Rotzinger, A. Monfardini, G. Catelani, and I. M. Pop, Phys. Rev. Lett. **121**, 117001 (2018).
- N. Maleeva, L. Grünhaupt, T. Klein, F. Levy-Bertrand, O. Dupre, M. Calvo, F. Valenti, P. Winkel, F. Friedrich, W. Wernsdorfer, A.V. Ustinov, H. Rotzinger, A. Monfardini, M.V. Fistul, and I.M. Pop, Nat. Commun. 9, 3889 (2018).
- P. Kamenov, W.-S. Lu, K. Kalashnikov, T. DiNapoli, M. T. Bell, and M. E. Gershenson, Phys. Rev. Appl. 13, 054051 (2020).
- 17. T.E. Wilson, Meas. Sci. Technol. 18, N53 (2007).
- L. J. Splitthoff, A. Bargerbos, L. Grünhaupt, M. Pita-Vidal, J. J. Wesdorp, Y. Liu, A. Kou, C. K. Andersen, and B. van Heck, Phys. Rev. Appl. 18, 024074 (2022).
- 19. D.Y. Vodolazov, JETP Lett. 118, 773 (2023).
- M. Malnou, M. Vissers, J. Wheeler, J. Aumentado, J. Hubmayr, J. Ullom, and J. Gao, PRX Quantum 2, 010302 (2021).
- B.-K. Tan, N. Klimovich, R. Stephenson, F. Faramarzi, and P. Day, Supercond. Sci. Technol. 37, 035006 (2024).
- D. J. Parker, M. Savytskyi, W. Vine, A. Laucht, T. Duty, A. Morello, A. L. Grimsmo, and J. J. Pla, Phys. Rev. Appl. 17, 034064 (2022).
- L.J. Splitthoff, J.J. Wesdorp, M. Pita-Vidal, A. Bargerbos, Y. Liu, and C.K. Andersen, Phys. Rev. Appl. 21, 014052 (2024).
- M. Khalifa, P. Feldmann, and J. Salfi, Phys. Rev. Appl. 22, 024025 (2024).
- 25. J. Baselmans, J. Low Temp. Phys. 167, 292 (2012).
- 26. S. Doyle, P. Mauskopf, J. Naylon, A. Porch, and C. Duncombe, J. Low Temp. Phys. **151**, 530 (2008).
- F. Levy-Bertrand, A. Benoît, O. Bourrion, M. Calvo, A. Catalano, J. Goupy, F. Valenti, N. Maleeva, L. Grünhaupt, I. Pop, and A. Monfardini, Phys. Rev. Appl. 15, 044002 (2021).
- A.E. Schegolev, N.V. Klenov, S.V. Bakurskiy, I.I. Soloviev, M.Y. Kupriyanov, M.V. Tereshonok, and A.S. Sidorenko, Beilstein J. Nanotechnol. 13, 444 (2022).
- A. A. Golubov, M. Y. Kupriyanov, and E. Il'Ichev, Rev. Mod. Phys. 76, 411 (2004).
- 30. A.I. Buzdin, Rev. Mod. Phys. 77, 935 (2005).
- F. Bergeret, A.F. Volkov, and K.B. Efetov, Rev. Mod. Phys. 77, 1321 (2005).
- 32. M. Blamire and J. Robinson, J. Phys. Condens. Matter 26, 453201 (2014).
- 33. M. Eschrig, Rep. Prog. Phys. 78, 104501 (2015).

- 34. N.O. Birge and N. Satchell, APL Mater. 12, 041105 (2024).
- A. Neilo, S. Bakurskiy, N. Klenov, I. Soloviev, and M. Kupriyanov, Nanomaterials 13, 1970 (2023).
- L. Karelina, N. Shuravin, S.Z Egorov, V. Bol'ginov, and V. Ryazanov, JETP Lett. **119**, 633 (2024).
- A. Neilo, S. Bakurskiy, N. Klenov, I. Soloviev, and M. Kupriyanov, Nanomaterials 14, 245 (2024).
- A. Neilo, S. Bakurskiy, N. Klenov, I. Soloviev, V. Stolyarov, and M. Kupriyanov, Appl. Phys. Lett. 125, 162601 (2024).
- 39. М. Ю. Куприянов, Лукичев, ЖЭТФ 94, 139 (1988).
- J. R. Clem and V. Kogan, Physical Review B: Condensed Matter and Materials Physics 86, 174521 (2012).
- 41. T. Kubo, Physical Review Research 2, 033203 (2020).
- P. Marychev and D. Y. Vodolazov, J. Phys. Condens. Matter 33, 385301 (2021).
- P. Marychev and D. Y. Vodolazov, Phys. Rev. B 105, 094522 (2022).
- D.Y. Vodolazov, A.Y. Aladyshkin, E. Pestov, S. Vdovichev, S. Ustavshikov, M.Y. Levichev, A. Putilov, P. Yunin, A. El'kina, N. Bukharov, and A.M. Klushin, Superconductor Supercond. Sci. Technol. **31**, 115004 (2018).
- S. Ustavschikov, M.Y. Levichev, I.Y. Pashenkin, A. Klushin, and D.Y. Vodolazov, Supercond. Sci. Technol. 34, 015004 (2020).
- M.Y. Levichev, I.Y. Pashenkin, N. Gusev, and D.Y. Vodolazov, Phys. Rev. B 108, 094517 (2023).
- 47. A. Murphy, D. V. Averin, and A. Bezryadin, New J. Phys. **19**, 063015 (2017).
- H. Dausy, L. Nulens, B. Raes, M.J. van Bael, and J. van de Vondel, Phys. Rev. Appl. 16, 024013 (2021).
- E. Il'ichev, M. Grajcar, R. Hlubina, R. P. IJsselsteijn, H. E. Hoenig, H. G. Meyer, A. Golubov, M. H. Amin, A. M. Zagoskin, A. N. Omelyanchouk, and M. Y. Kupriyanov, Phys. Rev. Lett. 86, 5369 (2001); ISSN 1079-7114; 0031-9007.
- A. G. P. Troeman, S. H. W. van der Ploeg, E. Il'Ichev, H.-G. Meyer, A. A. Golubov, M. Y. Kupriyanov, and H. Hilgenkamp, Phys. Rev. B 77, 024509 (2008).
- S. M. Frolov, M. J. Stoutimore, T. A. Crane, D. J. van Harlingen, V. A. Oboznov, V. V. Ryazanov, A. Ruosi, C. Granata, and M. Russo, Nat. Phys. 4, 32 (2008).
- L. V. Ginzburg, I. Batov, V. V. Bol'ginov, S. V. Egorov, V. I. Chichkov, A. E. Shchegolev, N. V. Klenov, I. Soloviev, S. V. Bakurskiy, and M. Y. Kupriyanov, JETP Lett. **107**, 48 (2018).